

# 近時の特許権侵害訴訟の充足論における クレーム解釈



会員・弁護士 中所 昌司

## 要 約

イ号製品が特許発明の技術的範囲に含まれるか否か（充足論）の判断は、事件ごとの、多種多様な特許発明とイ号製品とによるものであり、容易ではないことが多い。

そこで、本稿では、ケース・スタディとして、近時の特許権侵害訴訟において充足論について判断された裁判例について、紹介する。

## 目次

1. はじめに
2. 洗濯機事件（東京地裁平成 26 年 7 月 23 日判決）
  - (1) 事件の概要
  - (2) 本件 688 特許
  - ア. 構成要件の分説
  - イ. 本件 688 発明の内容
  - ウ. 充足論の判断
    - (ア) 「前記検知工程による検知を条件に」
    - (イ) 「洗濯物が取り出された状態で」
  - (3) 本件 893 特許
  - ア. 構成要件の分説
  - イ. 本件 893 発明 14 の内容
  - ウ. 充足論の判断
3. 単結晶炭化珪素事件（東京地裁平成 26 年 7 月 17 日判決）
  - (1) 事件の概要
  - (2) 構成要件の分説
  - (3) 本件発明の内容
  - (4) 充足論の判断
4. 電子材料用銅合金事件（東京地裁平成 26 年 6 月 24 日判決）
  - (1) 事件の概要
  - (2) 構成要件の分説
  - (3) 本件訂正発明 2 の内容
  - (4) 充足論の判断
5. p 型窒化ガリウム系化合物半導体事件（東京地裁平成 26 年 5 月 22 日判決）
  - (1) 事件の概要
  - (2) 構成要件の分説
  - (3) 本件発明の内容
  - (4) 充足論の判断
6. 車椅子事件（東京地裁平成 26 年 4 月 24 日判決）
  - (1) 事件の概要
  - (2) 構成要件の分説
  - (3) 本件発明の内容

- (4) 充足論の判断
7. おわりに

## 1. はじめに

弁理士は、知的財産の専門家として、出願代理に限られない広範な場面での使命を負っており<sup>(1)</sup>、侵害訴訟や侵害鑑定に関与することもある。

しかしながら、イ号製品が特許発明の技術的範囲に含まれるか否か（充足論）の判断は、事件ごとの、多種多様な特許発明とイ号製品とによるものであり、容易ではないことが多い。

例えば、クレームの文言だけを見るならばその範囲を広く解することが可能な場合であっても、明細書に開示された特許発明の技術思想を考慮して限定的に解釈され、その結果、イ号製品が構成要件を充足しないと判断されることがある<sup>(2)</sup>。他方で、特許発明は、明細書の実施例に直ちに限定されるものではないので、イ号製品の構成が実施例とは異なるものであっても、特許発明の構成要件を充足すると判断されることもある。

そこで、本稿では、ケース・スタディとして、近時の特許権侵害訴訟において充足論について判断された裁判例について、紹介する。

## 2. 洗濯機事件（東京地裁平成 26 年 7 月 23 日判決）

### (1) 事件の概要

本件は、原告らが、洗濯機に関する 3 件の特許権に基づいて、家電メーカーを特許権侵害で訴えた事案である。

特許第 4917688 号（「本件 688 特許」）に係る特許権

の侵害の成否について、裁判所は、口号製品は本件 688 特許の請求項 1 に記載の発明（「本件 688 発明」）の構成要件を充足すると判断し、侵害を認めた。

また、特許第 4307521 号（「本件 521 特許」）に係る特許権の侵害の成否について、裁判所は、ハ号製品は本件 521 特許の請求項 1 ないし 3 に記載の発明（「本件 521 発明 1 ないし 3」）の構成要件を充足すると判断したが、無効の抗弁（特許法 104 条の 3 第 1 項）を認め、侵害を否定した。

また、特許第 3205893 号（「本件 893 特許」）に係る特許権の侵害の成否について、裁判所は、ニ号製品は本件 893 特許の請求項 14 及び 15 に記載の発明（「本件 893 発明 14」及び「本件 893 発明 15」）の構成要件 E を充足しないと判断し、侵害を否定した。

上記のうち、本件 688 特許および本件 893 特許に関

する充足論の判断について、以下、紹介する。

(2) 本件 688 特許

ア. 構成要件の分説

本件 688 発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。（下線は引用者による。以下、同様。）

- A 開口部を有する外箱と、
- B 前記外箱の開口に設けた蓋と、
- C 前記外箱内に支持された外槽と、
- D 前記外槽内に回転自在に配置され、複数の脱水孔を有する洗濯兼脱水槽と、
- E 前記洗濯兼脱水槽に空気を供給する送風手段とを備え、
- F 洗い工程、すすぎ工程、脱水工程の順からなる洗

表 1 本稿で取り上げた近時の判決

判決日	裁判所	事件番号	特許番号	特許発明の対象	結論	構成要件の文言	裁判所の解釈
H26.7.23	東京地裁	H24(ワ)14652	第 4917688 号	洗濯機	充足	「前記検知工程による検知を条件に」	自動移行までは意味しないと、単に必要な条件と解釈。
					充足	「洗濯物を取り出された状態で」	「蓋の開閉が検知された場合に、洗濯物を取り出された状態となるのが通常の状態として予定されているものであること」を意味すると解釈。
			第 3205893 号	洗濯機	非充足	「前記貯留予備タンク側給水管の給水を制御する前記貯留予備タンク側給水弁」	「給水弁」とは、「制御部からの指令に基づき開閉することにより、水を蛇口等から槽等へ導入し又は導入を停止する働きをもつ弁」を意味すると解釈。
H26.7.17	東京地裁	H23(ワ)23651	第 3590464 号	4H 型単結晶炭化珪素インゴットの製造方法	非充足	「昇華再結晶法」	「生成物と同じ物質からなる多結晶固体原料を昇華させてから結晶させて単結晶の生成物を得ること」を意味すると解釈。
H26.6.24	東京地裁	H24(ワ)15614	第 3383615 号	電子材料用銅合金	非充足	「介在物個数が……45 個/mm <sup>2</sup> 以下」	0 個/mm <sup>2</sup> の場合には含まれないと解釈。
H26.5.22	東京地裁	H24(ワ)14227	第 2540791 号	p 型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法	充足	「実質的に水素を含まない雰囲気」	「アニーリングにより低抵抗な p 型窒化ガリウム系化合物半導体を得ることの妨げにならない程度にしか水素を含まない雰囲気」を意味すると解釈。
H26.4.24	東京地裁	H23(ワ)29033	第 3680160 号	車椅子	非充足	「支持」	ガイドフレームが座席フレーム体にかかる障害者の体重、すなわち重力方向（下向き）の力を支えるものであることを要すると解釈。

濯工程と、

- G 前記洗濯工程終了後、前記蓋の開閉を検知する検知工程とを有し、
- H I 前記検知工程による検知を条件に、前記洗濯兼脱水槽から洗濯物を取り出された状態で、前記送風手段から前記洗濯兼脱水槽内に供給された空気を、前記複数の脱水孔を介して前記洗濯兼脱水槽と前記外槽の隙間に流入させて前記洗濯兼脱水槽内部及び前記外槽壁面を乾燥させる槽乾燥工程へ移行すること
- J を特徴とした洗濯乾燥機。

上記の構成要件 A～D, F は、全自動洗濯機の一般的な構成である。

本件訴訟では、構成要件 HI の下線部の充足性が争われた。

#### イ. 本件 688 発明の内容

本件 688 発明は、洗い行程、すすぎ行程、脱水行程が自動的に進行する全自動洗濯機に関するものである。

従来の洗濯機では、洗濯工程終了後、次の洗濯開始時までの間、洗濯兼脱水槽内外壁及び外槽内壁が湿気の多い状態のまま閉塞状態に置かれることにより、これらの部分にカビや雑菌が発生し衛生上の問題が生じていた。

そこで、本件 688 発明は、送風手段により空気を洗濯兼脱水槽内に供給し、脱水孔を介して空気を洗濯兼脱水槽と外槽との隙間に流入させる槽乾燥工程を設けることで、洗濯兼脱水槽の内壁及び外槽の内壁を乾燥させるというものである。

#### ウ. 充足論の判断

(ア) 「前記検知工程による検知を条件に」

a. 被告は、構成要件 HI の「前記検知工程による検知を条件に」とは、蓋開閉検知により自動的に槽乾燥工程に移行する（動作開始条件）ことを意味すると主張した。そして、被告は、ロ号製品は、「スタート」キーの押下を条件に槽乾燥工程に移行するものであり、蓋の開閉検知から槽乾燥工程に自動移行するものではないのであるから、「前記検知工程による検知を条件に…槽乾燥工程へ移行」を充足しない旨主張した。

しかし、裁判所は、明細書の記載を参酌した上で、「検知を条件に」とは、単に蓋開閉検知がされなければ槽乾燥工程に移行しない（必要条件）ことを意味する

にとどまると解し、ロ号製品はこの要件を充足すると判断した。

この点に関して、本件明細書には、次のような記載があった。「なお、温風供給手段を動作させるタイミングとして、洗濯兼脱水槽 9 の停止後で、かつ、前記のように洗濯物を洗濯兼脱水槽 9 から取り出した後とするには、例えば蓋 18 の開閉を蓋スイッチで検知し、蓋 18 の開閉動作のあったことを条件として温風供給手段を動作させるようにすれば、実効的である。」（段落【0043】）

裁判所は、このような明細書の記載を参酌して、「蓋開閉検知は、洗濯兼脱水槽内から洗濯物を取り出された状態で槽乾燥工程が行われることを担保し、槽内の乾燥効率の向上という上記作用効果を確保するための構成であると解されるところである。」として、上記のように、「検知を条件に」を単に必要条件に過ぎないと判断した。

b. 被告は、「検知を条件に」を、蓋開閉検知により自動的に槽乾燥工程に移行することを意味すると解すべき根拠の 1 つとして、明細書の【発明を実施するための形態】の欄の次のような記載を挙げていた。「槽内の加熱は脱水運転終了後に自動的に開始するから、槽内を確実に乾燥することができる。」（段落【0042】）

これについて、裁判所は、当該記載は、「槽内の乾燥効率を向上させ、又は槽内を確実に乾燥させることを可能とする実施形態を開示したにとどまるものと解されるのであって、本件 688 発明が上記実施形態に開示された構成に限定されるべきものとは解されない。」とした。

(イ) 「洗濯物を取り出された状態で」

a. 被告は、構成要件 HI の「洗濯物を取り出された状態で、…槽乾燥工程へ移行する」とは、洗濯物を取り出されていない状態では槽乾燥工程に移行しないことを規定したものであると主張した。そして、被告は、ロ号製品は、洗濯物が槽内に残存している場合でも槽乾燥工程に移行するものであるから、ロ号製品は「洗濯物を取り出された状態で、…移行」を充足しない旨主張した。

b. しかし、裁判所は、以下のとおり、「洗濯物を取り出された状態で」とは、「蓋の開閉が検知された場合



に、洗濯物が取り出された状態となることが通常の状態として予定されているものであること」を意味すると解釈した。

「本件 688 発明は、蓋の開閉検知を条件として槽乾燥工程に移行するものとするので、洗濯物が取り出された状態で槽乾燥工程が行われることを担保し、槽内の乾燥効率の向上という作用効果を確保するものである。上記作用効果を確保するためには、蓋の開閉が検知された場合に、洗濯物が取り出された状態となることが予定されていることが当然必要となるものと解されるのであるから、『洗濯物が取り出された状態』とは、蓋の開閉が検知された場合に、洗濯物が取り出された状態となることが通常の状態として予定されているものであることを意味するにすぎないものと解するのが相当である（なお、本件 688 明細書の記載を検討しても、蓋の開閉検知のほかには、『洗濯物が取り出された状態』とするための技術的手段は開示されていない。）」

c. 「通常の状態として予定されているものであること」といったような要件は、一般的には、不明確とされたり、被告製品への当てはめが困難であったりする場合もあり得る。しかし、本件で、裁判所は、口号製品の取扱説明書には、槽乾燥工程に関し、「1 洗濯終了」、「2 ドアをあけて洗濯物を取り出す」、「3 ドアを閉めて『スタート』を押す」との記載があることなどから、口号製品は、洗濯工程終了後の蓋の開閉により洗濯物が取り出された状態となることが予定されているとして、当該構成要件を充足すると判断した。

d. 特許出願でクレーム作成をするときには、明確性の見地から、「通常」「予定されている」といった文言を使用することを、躊躇する場合がある。もっとも、実際のイ号製品においては、消費者が例外的な使用方法を用いる場合、文言上は、クレームの範囲に入るように見えたり、逆に、クレームの範囲外となるように見えることがあり得る。

そのような場合をも考慮した、明確かつ簡潔なクレームを起案することは難しい場合もあるので、本判決のように、侵害訴訟の場面で、特許発明の技術思想を全体的に考慮して、充足論の判断（クレーム解釈及び当てはめ）をすることは、合理的であると思われる。

### （3） 本件 893 特許

#### ア. 構成要件の分説

本件 893 発明 14 を構成要件に分説すると、次のとおりである。

- A 洗濯等を行う水槽、水道と前記水槽の間に介在して前記水道から前記水槽に水を供給する給水手段を備えた洗濯機において、
- B 前記水道と前記水槽とを接続する水道側給水管、
- C 給水のための貯留予備タンクと前記水槽とを接続する前記貯留予備タンク側給水管、
- D 前記水道側給水管の給水を制御する水道側給水弁、
- E 前記貯留予備タンク側給水管の給水を制御する前記貯留予備タンク側給水弁とを有する給水手段と、
- F 前記水槽内の水位を検出する検出部と、
- G 前記貯留予備タンクに貯留されている水を前記水槽に給水する給水工程で、前記給水工程中に前記検出部が検出した前記水槽内の水位の検出結果に基づき一定時間水槽内に給水がないと判断した場合に、前記水道から給水するよう前記給水弁を制御する制御手段と、
- H を備えたことを特徴とする洗濯機。

#### イ. 本件 893 発明 14 の内容

本件 893 発明 14 の「貯留予備タンク」とは、お風呂の浴槽などであり、当該特許発明は、要するに、お風呂の浴槽から洗濯機に給水をする工程で、お風呂の浴槽の水がなくなって給水が止まった時には、それを検出・判断して、水道からの給水に切り替える、というものである。

#### ウ. 充足論の判断

（ア） 被告は複数の構成要件の充足性を争ったが、裁判所は、構成要件 E の非充足についてのみ判断を示し、非侵害とした。

（イ） 構成要件 E の「前記貯留予備タンク側給水管の給水を制御する前記貯留予備タンク側給水弁」に関し、原告らは、閉じるべきときに閉じ、開くべきときに開くことによって、給水の水流を制御する弁であれば足り、電氣的制御を受けるものであることを要しない旨主張する一方、被告は、電磁的駆動弁であり、かつ、給水方向への流れを食い止める働きをするもので

あることを要する旨主張した。

これについて、裁判所は、まず、特許請求の範囲の請求項 14 の記載（特に構成要件 D, E 及び G）から、「貯留予備タンク側給水弁」とは、①制御手段による制御を受け、かつ、②貯留予備タンク側給水管の給水を制御する弁であると解釈した。

さらに、裁判所は、①制御手段による制御、及び、②給水の制御に関し、本件 893 明細書中の、本件 893 発明 14 以外の特許発明に関する記載も含めて参酌し、以下のように判断した。

「以上の本件 893 明細書の記載に照らせば、同明細書において、制御手段（制御部 12）とは、給水弁をその指令によって動作させるものであり、給水弁とは、制御手段（制御部 12）からの上記指令を受けて閉じ又は開くものであって、上記のとおり給水弁が閉じ又は開くことによって、給水が行われ又は給水が終了する、すなわち水を蛇口等から槽等へ導入し、又は上記導入を停止するものであることが一貫して記載されているものといえることができる。これに加えて、本件 893 明細書の請求項 11 において、制御部による制御に関し、『…検出手段からの信号に基づいて制御手段が各弁を制御することを特徴とする請求項 1 乃至 10 のいずれかに記載の洗濯機。』が発明として特定されており、制御部がその指令によって給水弁を制御することが明確化されていることも考慮すれば、本件 893 明細書において、『給水弁』とは、制御部からの指令に基づき開閉することにより、水を蛇口等から槽等へ導入し又は導入を停止する働きをもつ弁として記載されているものと解するのが相当であり、本件 893 発明 14 における『貯留予備タンク側給水弁』も、同様の意味をもつものとして記載されているものと解するのが相当である。」

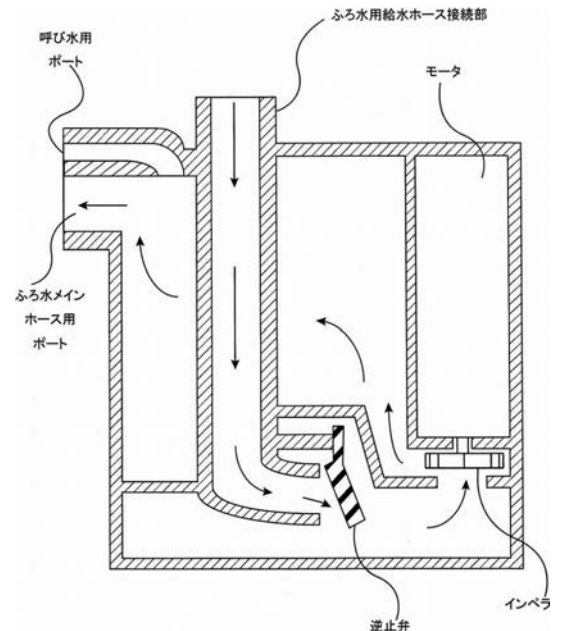
(ウ) 上記のクレーム解釈を前提として、裁判所は、二号製品の逆止弁について以下のとおり当てはめて、非充足と結論づけた。

「二号製品における逆止弁の開閉は、モータの作動及び羽根車（インペラ）の回転並びにこれらの停止によって生じる水圧により、その当然の帰結として生じる現象にすぎず、逆止弁自体が、制御手段からの指令に基づき開閉しているものと評価することはできない。また、二号製品におけるふろ水の洗濯・脱水槽への導入及びその停止は、モータの作動及び羽根車（イ

ンペラ）の回転によりふろ水を吸い上げ、又はこれらの作動・回転を停止することによって行われているものであり、逆止弁の開閉は、上記作動・回転の開始又は停止によってふろ水の洗濯・脱水槽への導入又は停止がされることにより、水圧が変化することによって生じているものにすぎないものであるから、逆止弁が、水を槽内等へ導入し又は導入を停止する働きを果たしているものとも評価することができないものである。

したがって、二号製品における逆止弁は、制御手段による制御を受け、かつ、貯留予備タンク側給水管の給水を制御する弁に当たらないから、『前記貯留予備タンク側給水管の給水を制御する貯留予備タンク側給水弁』を充足しない。」

【二号製品におけるふろ水給水ポンプの構造】<sup>(3)</sup>



(エ) 私見としては、上記の裁判所の二号製品への当てはめについては、反対の結論を採ることもあり得たようにも思われる。

すなわち、原告らは、（原告らの主張するクレーム解釈を前提として、）「二号製品における逆止弁は、給水される水流が生じているときには開き、給水される水流がなくなることによって閉じ、逆流を防止することで貯留予備タンクからの給水の流路を制御するものであって、かつ、羽根車の回転や電磁弁の開閉を介して、水道からの給水から貯留予備タンクからの給水に切り替えるよう制御されるものであるから、『貯留予備タンク側給水弁』に相当する。」と主張していた。

羽根車の回転や電磁弁の開閉は、制御部からの指令

に基づいて行われているものであろうから、逆止弁自体はゴム板であって直接に制御部から開閉の制御を受けているものではないとしても、間接的には制御部からの制御を受けていると評価することもできるように思われる。

また、本件では、二号製品の「逆止弁」が、構成要件 E の充足性の判断の対象とされ、当てはめが行われたが、逆止弁のみならず、モータ及び羽根車（インペラ）をも含めた機構全体を、「貯留予備タンク側給水弁」に該当するか否かの判断対象とすることも可能であったかもしれない。

### 3. 単結晶炭化珪素事件（東京地裁平成 26 年 7 月 17 日判決）

#### （1）事件の概要

本件は、4H 型単結晶炭化珪素の製造方法に関する特許権（特許番号第 3590464 号）を有する原告が、被告によるパワー半導体向け 4H 型炭化珪素ウエハの輸入、販売等がその特許権を侵害すると主張して、前記ウエハの販売行為等の差止めを求めた事案である。

裁判所は、被告方法は、本件発明（請求項 1 の発明）の構成要件 A を充足しないと判断し、侵害を否定した。

#### （2）構成要件の分説

本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。

- A 種結晶を用いた昇華再結晶法により
- B 単結晶炭化珪素を成長させる際に、
- C 炭素原子位置に窒素を  $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$  以上  $5 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$  以下導入することを特徴とする
- D 4H 型単結晶炭化珪素インゴットの製造方法。

本件では、構成要件 A 及び C の充足性が争点となっていたが、裁判所は、構成要件 A の非充足についてのみ、判断した。

#### （3）本件発明の内容

本件発明は、大型のウエハを切り出せる、欠陥が少なく良質の 4H 型単結晶炭化珪素インゴットを再現性良く製造するための方法であり、炭素原子位置に、あえて不純物（窒素）を導入することにより、結晶多形を 4H 型に制御しようとするものである。

明細書の【課題を解決するための手段】の欄には、

「本発明の単結晶炭化珪素インゴットの製造方法は、炭化珪素からなる原材料を加熱昇華させ、単結晶炭化珪素からなる種結晶上に供給し、この種結晶上に単結晶炭化珪素を成長する方法において、炭素原子位置に窒素を  $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$  以上  $5 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$  以下導入することを特徴とするものである。」（【0008】）という記載があり、【実施例】の欄には、「結晶成長は、種結晶として用いた単結晶炭化珪素基板 1 の上に、原料である炭化珪素粉末 2 を昇華再結晶させることにより行われる。」（【0017】）という記載があった。

明細書中、不純物（窒素）を導入する方法として、(1)不純物あるいは不純物元素を含有する化合物をガスとして導入する方法の他に、(2)不純物粉末を炭化珪素粉末と混合したものを原料として用いる方法、(3)事前に炭化珪素粉末と不純物の混合物を高温で熱処理したものを原料として用いる方法、あるいは(4)不純物をドーブした炭化珪素粉末を原料とする方法も挙げられていた（【0021】）。

しかし、その他に、明細書中に、原料について、生成物と異なる物質からなるものを用いることもあり得ることについては、何ら記載がなかった。

#### （4）充足論の判断

ア. 原告は、構成要件 A の「昇華再結晶法」の意義につき、生成物と同じ物質又は生成物と異なる物質からなる多結晶固体原料を昇華させてから結晶させ単結晶の生成物を得ることと主張し、被告方法は構成要件 A を充足すると主張した。

（被告方法は、最高裁のウェブサイト上で公開されている判決文では伏せ字にされているため明らかではないが、炭化珪素とは異なる物質からなる多結晶の固体原料を昇華させるものであったと推察される。）

イ. しかし、裁判所は、明細書の記載から、「昇華再結晶法」の意義について、以下のように判断した。

「本件発明は、高品質の単結晶炭化珪素を得るために導入された炭化珪素原料粉末を原料とし種結晶を用いて昇華再結晶を行う改良型のレーリー法においても解決できなかった課題を解決するために、炭化珪素からなる原材料を加熱昇華させ、単結晶炭化珪素からなる種結晶上に供給し、この種結晶上に単結晶炭化珪素を成長する方法において、炭素原子位置に窒素を  $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$  以上  $5 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$  以下導入するという技術手



段を採用したものであると認められる。そうだとすれば、構成要件 A の『昇華再結晶法』は、結晶性固体を『昇華』させて再び結晶させる、すなわち、生成物と同じ物質からなる多結晶固体原料を昇華させてから結晶させて単結晶の生成物を得ることを意味すると解するのが相当である。」

裁判所は、「昇華再結晶法」は、生成物と異なる物質を原料とする場合も含むという原告の主張について、炭化珪素に関する業界団体のウェブサイトや、炭化珪素の解説書の記載において、「これらは、レーリー法や改良レーリー法を昇華再結晶法として説明する場合に、炭化珪素を原料とすることをあえて明示し、炭化珪素を原料としないレーリー法や改良レーリー法を昇華再結晶法としていないことが認められる。」等として、原告の主張を採用しなかった。

ウ．特許発明の技術的範囲が、必ずしも明細書の実施例に限定されるものではないことは、前記洗濯機事件の本件 688 発明の構成要件の「前記検知工程による検知を条件に」の解釈について触れたとおりである。

しかしながら、特許請求の範囲の文言だけを見ると広く解され得る場合であっても、明細書と図面の全体を参酌した上で、開示された技術思想と異なる技術まで、特許発明の技術的範囲に含まれると解することは妥当ではない。したがって、本件のように、明細書の参酌によって、クレームが限定的に解される場合もあり得る。

ところで、特許請求の範囲の構成要件を文言上は充足しない場合でも侵害を認める均等論の趣旨として、「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができる」とすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」という点が挙げられている<sup>(4)</sup>。そして、侵害の範囲を特許請求の範囲の文言から例外的に拡張する均等侵害が認められるためには、その要件として、5 要件が課されている。

本件のように明細書の参酌によってクレームを限定

的に解釈することと、均等論によって一定の要件の下で侵害の範囲を拡大することは、侵害の肯否については逆方向のものではあるが、いずれも、特許制度を、特許権者と第三者との間で公平に運用するためのものであるという点では、共通するものと思われる。

#### 4. 電子材料用銅合金事件（東京地裁平成 26 年 6 月 24 日判決）

##### (1) 事件の概要

本件は、電子材料用銅合金に関する特許権（特許番号第 3383615 号）を有する原告が、被告による被告各製品の製造、販売等が上記特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、差止め及び損害賠償を求めた事案である。

裁判所は、被告各製品は、本件訂正発明 2（訂正後の特許請求の範囲の請求項 3 に記載の発明）の構成要件 F' を充足しないと判断し、また、無効の抗弁を認め、侵害を否定した。

##### (2) 構成要件の分説

本件訂正発明 2 を構成要件に分説すると、次のとおりである。

- A' 2.32～4.8mass%の Ni 及び
- B' 0.2～1.4mass%の Si を含有し、且つ Si に対する Ni の含有量 (mass%) 比が 2.7～5.1 になるように調整し、
- C' さらに Mg, Zn, Sn, Fe, Ti, Zr, Cr, P, Mn, Ag 又は Be のうち 1 種以上を総量で 0.005～2.0mass%含有し、
- D 残部が Cu 及び不可避的不純物からなり、
- E そして介在物の大きさが 10 $\mu$ m 以下であり、
- F'' 且つ 5～10 $\mu$ m の大きさの介在物個数が圧延方向に平行な断面で 45 個/mm<sup>2</sup>以下であり、導電率が 40% IACS 以上であり、引張強さが 670N/mm<sup>2</sup>以上であることを特徴とする
- G 強度及び導電性の優れた電子材料用銅合金。

本件訴訟では、構成要件 F' の下線部の充足性が争われた。

（被告各製品において、5～10 $\mu$ m の大きさの介在物個数が圧延方向に平行な断面で 0 個/mm<sup>2</sup>であることについては、争いがなかった。）

### (3) 本件訂正発明2の内容

本件訂正発明2は、十分な強度及び電気伝導度を有しつつ、さらに曲げ加工性、エッチング性及びめっき性に優れた電子材料用銅合金を提供することを目的とするもので、Cu-Ni-Si系合金の成分調整を行った上で、必要に応じMg等を含ませると共に、製造条件を制御・選定してマトリックス中の析出物、晶出物、酸化物等の介在物の分布の制御を行うことにより、電子材料用銅合金として好適な素材を提供するというものである（本件明細書【0006】、【0007】）。

また、本件明細書には、「介在物」とは、「鑄造時の凝固過程に生じる一般に粗大である晶出物並びに溶解時の溶湯内での反応により生じる酸化物、硫化物等、更には、鑄造時の凝固過程以降、すなわち凝固後の冷却過程、熱間圧延後、溶体化処理後の冷却過程及び時効処理時に固相のマトリックス中に析出反応で生じる析出物であり、本銅合金のSEM観察によりマトリックス中に観察される粗大な粒子を包括するものである」（【0009】）と記載され、「本発明者は、介在物の分布と曲げ加工性、エッチング性、めっき性との相関を調査し、5~10 $\mu$ mの粗大な介在物であっても、圧延方向に平行な断面において50個/mm<sup>2</sup>未満であれば、これらの特性を損なうことがないことを見出した。」（【0012】）等と記載されていた。

### (4) 充足論の判断

ア. 本件訴訟では、構成要件F'の「45個/mm<sup>2</sup>以下」の解釈として、0個/mm<sup>2</sup>の場合が含まれるか否かが問題となった。

本件明細書には上記のような記載があるほか、本件特許の特許出願に関しては、以下のような経緯があった。すなわち、審査官から、乙2文献及び乙3文献に基づく進歩性欠如をいう旨の拒絶理由通知が発せられたのに対して、出願人は、意見書において、「従来から、粗大な介在物は有害であることが知られていましたが、本願発明においては、上記した、『これら粗大な介在物の分布』について許容範囲を見出した点が大きな特徴であります。」「介在物粒子を小さくすれば特性改善が図れることは容易に判断できますが、……本願発明では、この合金系において、単に介在物の大きさだけでなく、引用文献1, 2（引用者注：侵害訴訟の乙2, 3文献）では開示されていない、単位面積当りの個数で表される、『介在物の分布』の概念を新たに導入

しました。すなわち、粒径がある程度大きな介在物があっても、その分布状態によっては、曲げ加工性、エッチング性、めっき性が低下せず、良好な特性が得られる事が判明しました。」等と主張して、結果として、特許査定を受けた。

イ. これについて、裁判所は、以下のように判断した。「本件明細書の記載によれば、本件訂正発明2は、『介在物の分布の制御を行うことにより』従来技術の問題点を解決するものであり……、5~10 $\mu$ mの粗大な介在物の分布が圧延方向に平行な断面において45個/mm<sup>2</sup>未満であれば曲げ加工性等の特性を損なうことがないとの知見……に基づくものである。そして、5~10 $\mu$ mの粗大な介在物が0個であれば『粗大な介在物の分布』は問題とならないから、本件明細書の記載を考慮すると、上記大きさの介在物が0個の場合はその技術的範囲に属しないと解することができる。

これに加え、原告は、析出物及び晶出物粒子の粒径をすべて5 $\mu$ m以下とすることは容易である旨をいう本件拒絶理由通知に対し、本件意見書において、介在物を小さくすれば銅合金の特性改善が図れることは知られていたが、粗大な介在物が存在してもその個数が一定限度であれば良好な特性が得られるという、粗大な介在物の分布の概念を新たに導入した点に本件発明の意義がある旨を述べたものである。本件意見書の上記記載は、5~10 $\mu$ mの大きさの介在物が存在する場合にのみ本件発明の技術的意義が認められ、5~10 $\mu$ mの介在物が0個の場合はその技術的範囲に含まれないことを前提としているものと解される。

そうすると、原告は、構成要件Fにいう『5~10 $\mu$ mの大きさの介在物個数が…50個/mm<sup>2</sup>未満』であることの意義につき、これが0個/mm<sup>2</sup>の場合を含まない旨を本件意見書において言明し、これにより本件拒絶理由通知に基づく拒絶を回避して特許登録を受けることができたものであるから、本件訴訟において上記介在物の個数が構成要件F'の『45個/mm<sup>2</sup>以下』に0個/mm<sup>2</sup>の場合が含まれると主張することは、上記出願手続における主張と矛盾するものであり、禁反言の原則に照らし許されないとすべきである。

したがって、構成要件F'にいう『45個/mm<sup>2</sup>以下』には0個/mm<sup>2</sup>の場合が含まれないと判断することが相当である。

……以上のとおり、構成1-f, 2-fは構成要件



F'」を充足せず、したがって、被告が製造販売する製品は、本件訂正発明2の技術的範囲に属しない。」

ウ。なお、裁判所は、仮に、「45個/mm<sup>2</sup>以下」には0個/mm<sup>2</sup>の場合が含まれると解した場合には、本件訂正発明2は、乙3文献により新規性を欠くものであると、無効論についての判断を示した。

エ。本件は、包袋禁反言の典型的な事例といえるであろう。

なお、本件侵害訴訟の係属中に、原告は、特許庁に対し、2度も訂正審判を請求し、訂正が認められた。一般に、侵害訴訟の係属中に訂正審判が請求されると、侵害訴訟の前提となる特許発明の内容が変更される可能性が生じてしまう。また、訂正審判の手続においては、被告は当事者として関与することができない。原告の訂正の機会を制限するためには、被告としては、特許庁に対して無効審判を請求することが考えられる（特許法126条2項、134条の2第1項参照）が、無効論についての審理が、侵害訴訟の裁判所と、特許庁の両方において行われることになってしまう。また、本件のように、特許請求の範囲の文言を狭く（「0個/mm<sup>2</sup>を含まない」と）解すると非充足により非侵害であり、特許請求の範囲を広く（「0個/mm<sup>2</sup>を含む」と）解しても無効の抗弁により非侵害である、という場合には、被告としては、充足論と無効論について、同一の判断主体、すなわち侵害訴訟の裁判所の判断に委ねた方が、自己に有利な結論を期待できる可能性もある。したがって、侵害訴訟の被告が無効審判を請求すべきか否かは、慎重な検討を要する。

## 5. p型窒化ガリウム系化合物半導体事件（東京地裁平成26年5月22日判決）

### （1）事件の概要

本件は、p型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法に関する特許権（特許番号第2540791号<sup>5)</sup>）を有していた原告が、被告は、窒化ガリウム系化合物半導体レーザー素子を組み込んだ半導体レーザー製品を製造、販売して原告の特許権を侵害したと主張して、被告に対し、損害賠償を求めた事案である。

裁判所は、被告方法は本件発明（特許請求の範囲の請求項1に係る発明）の構成要件を充足すると判断し、侵害を認めた。

### （2）構成要件の分説

本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。

- A 気相成長法により、p型不純物がドーブされた窒化ガリウム系化合物半導体を成長させた後、
- B 実質的に水素を含まない雰囲気中、
- C 400℃以上の温度でアニーリングを行い、
- D 上記p型不純物がドーブされた窒化ガリウム系化合物半導体層から水素を出す
- E ことを特徴とするp型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法。

本件訴訟では、構成要件B及びDの充足性が争われた。

### （3）本件発明の内容

本件明細書によれば、本件発明は、紫外、青色発光レーザーダイオード、紫外、青色発光ダイオード等の発光デバイスに利用されるp型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法に係り、詳しくは、気相成長法によりp型不純物をドーブして形成した窒化ガリウム系化合物半導体層を低抵抗なp型にする方法に関するものである（【0001】）。

本件明細書には、「反応後のp型不純物をドーブした窒化ガリウム系化合物半導体は高抵抗を示す。ところが、成長後アニーリングを行うことにより、Mg-H、Zn-H等の形で結合している水素が熱的に解離されて、p型不純物をドーブした窒化ガリウム系化合物半導体層から出て行き、正常にp型不純物がアクセプターとして働くようになるため、低抵抗なp型窒化ガリウム系化合物半導体を得られるのである。従って、アニーリング雰囲気中にNH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>等の水素原子を含むガスを使用することは好ましくない。」（【0022】～【0023】）等、記載されている。

### （4）充足論の判断

ア。以下、構成要件Bに関する充足論について紹介する。

裁判所は、本件明細書の記載等を参酌の上、以下のように判断した。

「本件発明は、アニーリングという技術手段を採用して、これにより、p型不純物をドーブした窒化ガリウム系化合物半導体から水素を出すという作用が生じ、p型窒化ガリウム系化合物半導体が製造されると

いう効果が得られるというものである。そして、この場合のアニーリング雰囲気は、真空中、N<sub>2</sub>、He、Ne、Ar等の不活性ガス又はこれらの不活性ガスの混合ガス雰囲気中で行うのが好ましく、さらに、アニーリング温度における窒化ガリウム系化合物半導体の分解圧以上で加圧した窒素雰囲気中で行うのが最も好ましいとされる。これに対し、アニーリング雰囲気中にNH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>等の水素原子を含むガスを使用したりキャップ層に水素原子を含む材料を使用することは、p型不純物に結合した水素原子を熱的に解離するというp型のための反応が進行せず、上記作用効果を奏しないことがあるので好ましくないとされるが、逆に、p型不純物に結合した水素原子を熱的に解離するというp型化のための反応が進行して、上記作用効果を奏することもあると考えられることから、アニーリング雰囲気中にNH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>等の水素原子を含むガスを使用したり、キャップ層に水素原子を含む材料を使用することが排除まではされていないとすることができる。

そうであれば、構成要件Bの『実質的に水素を含まない雰囲気』とは、このような作用効果を奏するような雰囲気、言い換えれば、アニーリングにより低抵抗なp型窒化ガリウム系化合物半導体を得ることの妨げにならない程度にしか水素を含まない雰囲気を意味するものと解するのが相当である。」

そして、裁判所は、当てはめ・結論として、「被告方法は、アニーリングにより低抵抗なp型窒化ガリウム系化合物半導体を得ることの妨げにならない程度にしか水素を含まない雰囲気中でアニーリングを行うものであって、本件発明の構成要件Bを充足する。」とした。

イ. なお、本件で、被告は、構成要件Bの「実質的に水素を含まない雰囲気」の解釈について、通常の方法では除去することができない程度にしか水素を含まない雰囲気を意味する旨、主張していた。

被告はその根拠の1つとして、「本件明細書の実施例におけるアニーリング雰囲気は窒素雰囲気又はアルゴンと窒素との混合ガス雰囲気であること等を挙げている。しかし、裁判所は、前記洗濯機事件と同様に、「実施例は発明の好ましい態様を開示したものであって、特許発明の技術的範囲が実施例に限定されるわけではない」等として被告の主張を認めなかった。

また、被告は、被告のクレーム解釈の根拠の1つとして、原告が、本件特許に対する特許異議申立事件に

おいて、構成要件B及びDを追加する訂正により、本件発明が水素を含まない雰囲気中でアニーリングを行うことを示して、本件刊行物に記載されている発明と区別して本件特許を維持したと主張した。しかし、裁判所は、「原告は、取消理由を解消するために、本件刊行物に記載されている発明が、実質的に水素を含む雰囲気中でアニーリングを行う発明であると評価して、実質的に水素を含まない雰囲気中でアニーリングを行う本件発明と相違するとの意見を述べているのであって、原告が、『実質的に水素を含まない雰囲気』をもって、『通常の方法で除去することができない程度にしか水素を含まない雰囲気』を意味すると主張したということはできない。被告の上記主張は、採用することができない。」と判断した。

## 6. 車椅子事件(東京地裁平成26年4月24日判決)

### (1) 事件の概要

本件は、車椅子に関する特許権(特許番号第3680160号)を有する原告が、被告に対し、被告による被告製品の製造及び販売が特許権の侵害に当たる旨主張して、差止め及び損害賠償を求めた訴訟である。

裁判所は、被告製品は本件発明(特許請求の範囲の請求項1に係る発明)の構成要件B-3を充足しないと判断し、侵害を否定した。

### (2) 構成要件の分説

本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。

- A 前輪と後輪とを支持する車輪フレーム体が、介護者用のハンドル部を有する背フレーム・サイドフレーム・脚フレームを有して障害者を座位可能に支持する座席フレーム体を間にして左右一対に配置されて構成される車椅子であって、
- B それぞれの前記車輪フレーム体は、
  - B-1 前記座席フレーム体の両側において、前記座席フレーム体に軸着して前記座席フレーム体を揺動可能に支持する上部フレームと、
  - B-2 前記上部フレームの下方に配置される下部フレームと、
  - B-3 前記座席フレーム体の両側部において前記座席フレーム体の揺動時に前記座席フレーム体を支持して摺動可能なガイド手段を構成するガイドフレームと、を有して枠体状に構成されている

C ことを特徴とする車椅子。

本件訴訟では、構成要件 B - 3 の「支持」の充足性が争われた。

### (3) 本件発明の内容

本件発明は、障害者が座位姿勢のままリクライニング可能に構成された車椅子に関するものである。

本件明細書には、以下の趣旨の記載がある。

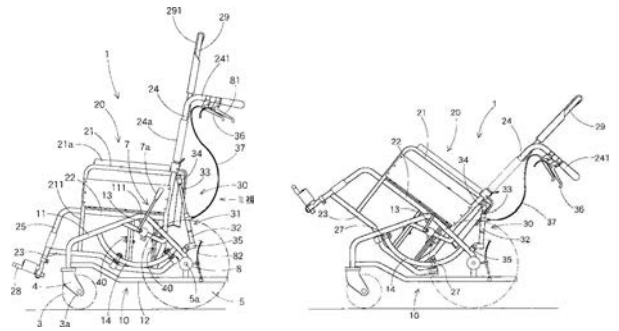
「従来技術のリクライニング可能な車椅子は、座席フレーム体がサイドフレームと前フレームと後フレームと背フレームとを有して構成され、背フレームが座（又はサイドフレーム）に対して傾倒するというものである。そのため、①障害者は座位した姿勢を崩さずにリクライニングすることができず、重度な障害者ではリクライニング動作が困難となることがあるという問題点と、②背フレームが座（又はサイドフレーム）に対してピンのみで支持するように構成されていることから、ピンで障害者の重量を受けることとなり、ピンが破損しやすく危険を伴うという問題点があった。（段落【0002】～【0006】）

本件発明は、上記問題点を解決するためにされたものであり、①障害者の安定した姿勢を保持した状態でリクライニング作用が行なえるとともに、②堅固に構成されたリクライニング機構を有する車椅子を提供することを目的とする。（段落【0007】）

……本件発明の車椅子は、座席フレーム体の背フレームを、車輪フレーム体に対して傾倒させる際、座席フレーム体は、車輪フレーム体のガイドフレームに案内されながら、左右一対の車輪フレーム体に対して揺動される。そして、①座席フレーム体は、背フレームとサイドフレームと脚フレームとを備えて構成されていることから、座席フレーム体に座位する障害者は、座位姿勢のままリクライニング作用を行なうことができ、身体を動かさない重度な障害者であっても、安定した姿勢でリクライニングすることが可能となる。さらに、②座席フレーム体が、車輪フレーム体に対して揺動する際、揺動支点部のピンだけでなくガイド手段で支持されて摺動することができることから、障害者の体重を十分に支持することができ、障害者を安心して車椅子に搭乗させてリクライニングさせることができる。（段落【0013】）」<sup>(6)</sup>

【本件発明の実施形態の図面】<sup>(7)</sup>（符号 14 がガイドフレーム。符号 23 が、座席フレーム体 20 の一部である底フレーム。）

(a) 座席フレーム体を立てた状態 (b) リクライニング状態

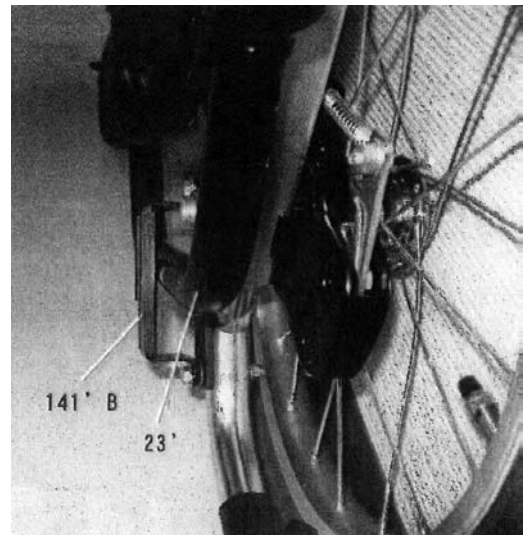


### (4) 充足論の判断

ア. 本件訴訟では、構成要件 B - 3 の充足性、特に「支持」の解釈等が争われた。

被告製品は、車輪フレーム体に、内側に座席フレーム体の底フレームが挿通され、座席フレーム体の両側部において車輪フレーム体の間隔を規制する構成を有する間隔規制枠を備えていた。原告は、この間隔規制枠が構成要件 B - 3 にいう「ガイド手段を構成するガイドフレーム」に当たり、上記のような間隔規制枠の構成は、下向きにかかる力を支えるものでないとしても、構成要件 B - 3 の「支持」を充足する旨主張していた。

【イ号物件の間接規制枠 141' B と底フレーム 23' の写真】<sup>(8)</sup>



イ. 裁判所は、まず、特許請求の範囲の記載について検討し、争点となっている構成要件 B - 3 以外に、構成要件 A 及び構成要件 B - 1 にも、「支持」という同一の文言が用いられていることに着目し、以下のように述べた。

「本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 には、ガイ



ドフレームが座席フレーム体を『支持』すること（構成要件 B - 3）に加え、上部フレームが座席フレーム体を『支持』すること（構成要件 B - 1）が記載されており、ガイドフレームが上部フレームと共に座席フレーム体を支持するものであることが本件発明の構成要件とされている。そして、座席フレーム体は障害者を座位可能に『支持』するものであり（構成要件 A）、障害者の体重が座席フレーム体に対して下向き（重力方向）にかかることは明らかであるから、ガイドフレーム及び上部フレームが座席フレーム体を『支持』するとは、下向きにかかる障害者の体重及び座席フレーム体の重量を支えることを意味するといえることができる。そうすると、特許請求の範囲の文言上、『支持』の具体的な構成についての記載はないものの、下向きにかかる力を支えない場合には『支持』に当たらないと解することができる。」

ウ. 裁判所は、続いて、以下のように、明細書の内容も参酌した上で、「支持」の意義を解釈した。

「本件明細書の上記記載を総合すると、本件発明は、従来の車椅子には、リクライニング時に、①座位した姿勢を崩さずにリクライニングすることができず、重度な障害者ではリクライニング動作が困難となることがあり、また、②ピンで障害者の重量を受けることから、ピンが破損しやすく危険を伴うという問題点があったので、これらを解決するため、①座席フレーム体については、背フレームとサイドフレームと脚フレームとを備え、その全体が車輪フレーム体に対して揺動するように構成するとともに、②車輪フレーム体は、座席フレーム体が車輪フレーム体に対して揺動する際に、座席フレーム体と車輪フレーム体が軸着される上部フレームの揺動支点部のみならず、ガイドフレームでも障害者の体重を支えて摺動することができる構成を採用したものであると認められる。したがって、構成要件 B - 3 にいう『支持』とは、ガイドフレームが上部フレームと共に障害者の体重（下向きの力）を支えることをいうもの、換言すると、上部フレームの揺動支点部にかかる障害者の体重による負荷を軽減するために、ガイドフレームにも上記負荷がかかるものであることを要すると解釈することができる。以上によれば、構成要件 B - 3 にいう『支持』に当たるというためには、ガイドフレームが座席フレーム体にかかる障害者の体重、すなわち重力方向（下向

き）の力を支えるものであることを要すると判断することが相当である。」

エ. 裁判所は、当てはめ・結論として、被告製品は、座席フレーム体にかかる障害者の体重を支えるものとはいえないから、構成要件 B - 3 の「支持」を充足しないと判断した。

オ. 本件は、クレームの文言解釈において、特許請求の範囲の他の構成要件に記載された同一の文言の用例、及び、明細書に開示された技術思想を参酌して、クレームの文言を限定的に解釈した一例といえるであろう。

## 7. おわりに

以上、近時の 5 件の判決における充足論の判断を紹介した。充足論の判断は、個別の事件ごとの、特許発明とイ号製品とによるものではあるが、ケース・スタディとして、参考にして頂ければ幸甚である。

### (注記)

- (1) 平成 26 年 4 月に成立した弁理士法の一部改正案により、弁理士法第 1 条が、「弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」とされることとなり、「知的財産に関する専門家」としての弁理士の使命が明確化された。
- (2) 特許法 70 条 1 項には、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定され、同 2 項には、「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定されている。  
したがって、特許権侵害訴訟において特許発明の技術的範囲を確定する場面では、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟であるリバーゼ事件の判決（最高裁平成 3 年 3 月 8 日）で示された制限を受けることなく、明細書及び図面を考慮することができる。
- (3) 本件判決から引用。
- (4) 最高裁平成 10 年 2 月 24 日判決（ボールスプライン軸受け事件）。
- (5) なお、本件特許の発明者の 1 人は、2014 年ノーベル物理学賞受賞者の中村修二氏である。
- (6) 本件判決から引用。
- (7) 本件特許公報から引用。
- (8) 本件判決別紙イ号物件目録写真 8B から引用。

(原稿受領 2014. 9. 24)